

Machine De Revêtement Par Évaporation Améliorée Par Plasma Pecvd

Numéro d'article: KT-PED



Introduction

Améliorez votre processus de revêtement avec l'équipement de revêtement PECVD. Idéal pour les LED, les semi-conducteurs de puissance, les MEMS, etc. Dépose des films solides de haute qualité à basse température.

[En savoir plus](#)

| | | |
|------------------------|----------------------------|--|
| Porte-échantillon | Taille | 1-6 pouces |
| | Vitesse de rotation | 0-20rpm réglable |
| | Température de chauffage | ≤800°C |
| | Précision du contrôle | ±0.5°C Contrôleur PID SHIMADEN |
| Purge de gaz | Débitmètre | CONTRÔLEUR DE DÉBITMÈTRE MASSIQUE (MFC) |
| | Canaux | 4 canaux |
| | Méthode de refroidissement | Refroidissement par circulation d'eau |
| Chambre à vide | Taille de la chambre | Φ500mm X 550mm |
| | Port d'observation | Port d'observation avec déflecteur |
| | Matériau de la chambre | Acier inoxydable 316 |
| | Type de porte | Porte à ouverture frontale |
| | Matériau du capuchon | Acier inoxydable 304 |
| | Orifice de la pompe à vide | Bride CF200 |
| | Orifice d'entrée de gaz | φ6 Connecteur VCR |
| Puissance du plasma | Alimentation de la source | Alimentation DC ou RF |
| | Mode de couplage | Couplage inductif ou capacitif à plaque |
| | Puissance de sortie | 500W-1000W |
| | Puissance de polarisation | 500v |
| Pompe à vide | Pré-pompe | Pompe à vide à palettes 15L/S |
| | Orifice de la turbopompe | CF150/CF200 620L/S-1600L/S |
| | Orifice de décharge | KF25 |
| | Vitesse de la pompe | Pompe à palettes:15L/s[]Turbo pompe:1200l/s[]1600l/s |
| | Degré de vide | ≤5×10-5Pa |
| | Capteur de vide | Jauge à vide à ionisation/résistance/jauge à film |
| Systeme d'alimentation | Alimentation électrique | AC 220V /380 50Hz |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale | 5kW |
| Dimensions de l'appareil | 900mm X 820mm X 870mm |
| Poids | 200 kg |